

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 13

УТВЕРЖДАЮ
Ответственный за образовательную
программу

доц., к.т.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

В.К. Пономарев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

«24» июня 2024 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Микромеханические приборы и устройства»
(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	24.03.02
Наименование направления подготовки/ специальности	Системы управления движением и навигация
Наименование направленности	Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации
Форма обучения	очная
Год приема	2024

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

доцент, к.т.н.

(должность, уч. степень, звание)

(подпись, дата)

Н.А. Овчинникова

(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 13

«24» 06 2024 г, протокол № 11

Заведующий кафедрой № 13

доцент, к.т.н.

(уч. степень, звание)

(подпись, дата)

Н.А. Овчинникова

(инициалы, фамилия)

Заместитель директора института №1 по методической работе

доц., к.т.н.

(должность, уч. степень, звание)

(подпись, дата)

В.Е. Таратун

(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Микромеханические приборы и устройства» входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 24.03.02 «Системы управления движением и навигация» направленности «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации». Дисциплина реализуется кафедрой «№13».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

ПК-1 «Способен разрабатывать отдельные детали и узлы для приборов ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов ракетно-космической техники»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением принципа действия и проведением расчетов микромеханических приборов и устройств, а также и экспериментальному исследованию их характеристик.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский»

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Целью дисциплины «Микромеханические приборы и устройства» является изучение принципов построения, проектирования и изготовления микромеханических приборов и устройств, обладающих уникальными массогабаритными и стоимостными характеристиками, ознакомление с областями их применения и перспективами развития.

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Профессиональные компетенции	ПК-1 Способен разрабатывать отдельные детали и узлы для приборов ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов ракетно-космической техники	ПК-1.3.1 знать основы проектирования и расчета элементов и узлов приборов и систем ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов ПК-1.У.1 уметь выполнять необходимые расчеты, связанные с проектированием элементов и узлов приборов и систем ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов ПК-1.В.1 владеть методиками проектирования, в том числе с использованием компьютерных технологий

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- Математика;
- Теоретическая механика;
- Физика;
- Основы теории управления;
- Электроника;
- Основы моделирования приборов и систем;
- Автоматизация инженерных расчетов;
- Технология приборостроения;
- Гироскопические приборы и системы.

– Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и используются при подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра.

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№8
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	3/ 108	3/ 108
Из них часов практической подготовки	20	20
Аудиторные занятия, всего час.	40	40
в том числе:		
лекции (Л), (час)	20	20
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)		
лабораторные работы (ЛР), (час)	20	20
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)		
экзамен, (час)	27	27
Самостоятельная работа, всего (час)	41	41
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Экз.	Экз.

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.
Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 8					
Раздел 1. Микромеханические датчики и актуаторы					
Тема 1.1. Датчики давления	4				9
Тема 1.2 МЭМС - датчики магнитного поля					
Тема 1.3 МЭМС – актуаторы					
Раздел 2. Теоретические основы микромеханических гироскопов (ММГ) и акселерометров (ММА)					
Тема 2.1 Основные структуры и модели динамики ММГ LL, RR и R типов					
Тема 2.2. Основные схемы и принципы функционирования ММГ	6		20		12
Тема 2.3 Основные схемы и принципы функционирования микромеханических акселерометров					
Тема 2.4 Статика и динамика ММГ и ММА.					
Тема 2.5 Основные технологические процессы производства ММГ и ММА					

Раздел 3. Микромеханические инерциальные модули и системы ориентации и навигации					
Тема 3.1 Микромеханические инерциальные модули	4				12
Тема 3.2 Микромеханические системы ориентации и навигации					
Раздел 4. Элементная база и основы технологии производства микромеханических структур					
Тема 4.1 Элементная база МЭМС	6				8
Тема 4.2 Характеристики материалов используемых при производстве МЭМС					
Тема 4.3 Основные технологические процессы производства МЭМС					
Итого в семестре:	20		20		41
Итого	20	0	20	0	41

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
1	<p>Раздел 1. Микромеханические датчики и актуаторы</p> <p>Тема 1.1. Датчики давления</p> <p>Датчики давления прямого преобразования. Анизотропия электрического сопротивления полупроводниковых тензорезисторов. Топология тензорезисторов. Чувствительность тензорезистивных схем. Демпфирование колебаний. Динамика колебаний и передаточные функции. Датчики давления компенсационного типа. Датчики с электростатической обратной связью. Датчики с магнитоэлектрической обратной связью.</p> <p>Тема 1.2 МЭМС - датчики магнитного поля</p> <p>Свойства проводимости металлических пленок. Топология магниторезисторов. Чувствительность магниторезисторов. Схемотехника преобразователей. 3 – осевые магнитометры. Преобразование базисов магнитных измерений. МЭМС – компасы.</p> <p>Тема 1.3 МЭМС – актуаторы</p> <p>Назначение. Область применения. Цифровое микрозеркальное устройство (DMD). Принцип действия, топология. DLP –</p>

	<p>проекторы. Пьезоструйныеактуаторы для принтеров. Микромеханические переключатели. Микротранспортеры. Микротурбины. Микроинструменты для глазной хирургии.</p>
2	<p>Раздел 2. Теоретические основы микромеханических гироскопов (ММГ) и акселерометров (ММА)</p> <p>Тема 2.1 Основные структуры и модели динамики ММГ LL, RR и R типов. Динамика взаимодействия первичных и вторичных колебаний ММГ LL и RR типов. Волновые твердотельные гироскопы (ММГ R -типа).</p> <p>Тема 2.2. Основные схемы и принципы функционирования ММГ. Структурные схемы, передаточные функции, масштабные коэффициенты преобразования ММГ LL, RR и R типов. Основные погрешности ММГ.</p> <p>Тема 2.3. Основные схемы и принципы функционирования микромеханических акселерометров (ММА).</p> <p>Классификация ММА (одномерные и двумерные, осевые и маятниковые, прямого преобразования и компенсационного типа).</p> <p>Тема 2.4 Статика и динамика ММГ и ММА. Модели динамики, структурные схемы, передаточные функции, масштабные коэффициенты преобразования, рабочая полоса частот, основные погрешности ММГ и ММА.</p> <p>Тема 2.5. Основные технологические процессы производства ММГ и ММА.</p> <p>Обобщенный технологический процесс производства ММГ и ММА. Основные технологические операции производства, включающие: литографию, получение слоев различных материалов, травление, микросборочные операции, испытание изделий.</p>
3	<p>Раздел 3. Микромеханические инерциальные модули и системы ориентации и навигации</p> <p>Тема 3.1 Микромеханические инерциальные модули. Назначение, функциональность, основные элементы, основные характеристики.</p> <p>Тема 3.2 Микромеханические системы ориентации и навигации. Назначение, функциональность, принцип построения, основные характеристики.</p>
4	<p>Раздел 4. Элементная база и основы технологии производства микромеханических структур</p> <p>Тема 4.1 Элементная база МЭМС</p> <p>Электростатические датчики сил и моментов, емкостные и тензометрические преобразователи микроперемещений, элементы упругих подвесов чувствительных элементов, системы возбуждения ММГ.</p> <p>Тема 4.2 Характеристики материалов используемых при производстве МЭМС</p> <p>Физико-химические свойства кремния, как основного</p>

	<p>конструкционного материала для изготовления чувствительных элементов. Другие материалы .</p> <p>Тема 4.3 Основные технологические процессы производства МЭМС</p> <p>Обобщенный технологический процесс производства МЭМС. Основные технологические операции производства, включающие: литографию, получение слоев различных материалов, травление, микросборочные операции, испытание изделий.</p>
--	---

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено					
Всего					

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 8				
1.	Экспериментальное исследование ММГ LL – типа	4		2
2.	Моделирование измерительного канала ММГ RR – типа	4		2
3.	Моделирование динамики ММГ R – типа	4		2
4.	Экспериментальное исследование двумерного ММА осевого типа	4		2
5.	Моделирование системы возбуждения ММГ	4		2
Всего		20		

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Учебным планом не предусмотрено

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 8, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	30	30
Курсовое проектирование (КП, КР)		
Расчетно-графические задания (РГЗ)		
Выполнение реферата (Р)		
Подготовка к текущему контролю успеваемости (ТКУ)	6	6
Домашнее задание (ДЗ)		
Контрольные работы заочников (КРЗ)		
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	5	5
Всего:	41	41

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
681.2 Р 24	Распопов В.Я. Микромеханические приборы. Тула, 2002, 367 с.	6
629.7 М59	Микросистемы ориентации беспилотных летательных аппаратов [Текст] / Р. В. Алалуев [и др.] ; ред. В. Я. Распопов. - М. : Машиностроение, 2011. - 184 с.	6
681.2 Р24	Приборы первичной информации : Микромеханические приборы [Текст] : учебное пособие / В. Я. Распопов ; Тул. гос. ун-т. - Тула : [б. и.], 2002. - 390 с.	6
681.58 М52	Меркурьев И.В., Подалков В.В. Динамика микромеханического и волнового твердотельного гироскопа.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009.–228 с.	6
531 Л84	Прикладная теория гироскопов [Текст] : учебник / Д. П. Лукьянов, В. Я. Распопов, Ю. В. Филатов ; Концерн	35

	"ЦНИИ "Электроприбор". - СПб. : Изд-во ЦНИИ "Электроприбор", 2015. - 316 с.	
629.7 С28	Северов Л.А. Механика гироскопических систем: Учебное пособие. – М.: МАИ (ТУ), 1996. – 212 с.	45

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
	Не предусмотрено

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

8.2. Перечень информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
	Не предусмотрено

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1.	Мультимедийная лекционная аудитория	13-04
2.	Специализированная лаборатория «Аэрокосмической микромеханики»	11-02

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену; Экзаменационные билеты; Тесты.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
«отлично» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; – уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; – умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий.
«хорошо» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; – не допускает существенных неточностей; – увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; – аргументирует научные положения; – делает выводы и обобщения; – владеет системой специализированных понятий.
«удовлетворительно» «зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; – допускает несущественные ошибки и неточности; – испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; – слабо аргументирует научные положения; – затрудняется в формулировании выводов и обобщений; – частично владеет системой специализированных понятий.
«неудовлетворительно» «не зачтено»	<ul style="list-style-type: none"> – обучающийся не усвоил значительной части программного материала; – допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; – испытывает трудности в практическом применении знаний; – не может аргументировать научные положения; – не формулирует выводов и обобщений.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
1	Классификация ММГ и ММА.	ПК-1.3.1
2	Принцип действия ММГ различных типов.	ПК-1.У.1
3	Модификации и принцип действия ММА.	ПК-1.В.1
4	Математическая модель динамики движения чувствительного элемента ММГ LL-типа.	ПК-1.3.1
5	Математическая модель динамики движения чувствительного элемента ММГ RR-типа.	ПК-1.3.1
6	Установившейся режим работы ММГ. Связь параметров колебаний с физическими параметрами чувствительного элемента.	ПК-1.3.1
7	Частотные характеристики ММГ и рабочая полоса частот.	ПК-1.3.1; ПК-1.В.1
8	Связь амплитудных и фазовых соотношений вторичных колебаний ММГ в установившемся режиме.	ПК-1.3.1
9	Статические и динамические характеристики ММА.	ПК-1.3.1 ПК-1.У.1; ПК-1.В.1
10	Источники ошибок в ММГ и ММА.	ПК-1.3.1
11	Аналитические методы расчета механических характеристик ММГ и ММА.	ПК-1.3.1; ПК-1.В.1
12	Принцип действия емкостных датчиков перемещений чувствительного элемента в ММГ и ММА. Основные соотношения. Вопросы проектирования.	ПК-1.3.1
13	Электростатические датчики управляющей силы и момента. Расчет энергетических характеристик и линейности преобразования.	ПК-1.3.1
14	Преобразователи «емкость - напряжение». Виды преобразователей и расчетные соотношения.	ПК-1.3.1
15	Структуры систем автогенераторного возбуждения первичных колебаний в ММГ. Расчет параметров установившихся колебаний.	ПК-1.3.1; ПК-1.У.1 ПК-1.В.1
16	Структура и принцип работы системы возбуждения первичных колебаний в ММГ с опорным генератором.	ПК-1.3.1
17	Формирование контура фазовой подстройки частоты опорного генератора. Выбор параметров контура.	ПК-1.3.1
18	Принципы формирования выходного сигнала в ММГ и ММА в приборах прямого измерения.	ПК-1.3.1 ПК-1.У.1; ПК-1.В.1
19	Формирования выходного сигнала в ММГ и ММА в приборах компенсационного типа.	ПК-1.3.1; ПК-1.У.1
20	Стабилизация амплитуды первичных колебаний ММГ управлением амплитудой импульсов возбуждения.	ПК-1.3.1
21	Стабилизация амплитуды первичных колебаний ММГ управлением длительностью импульсов возбуждения.	ПК-1.3.1
22	Основные технологические процессы производства ММГ и ММА.	ПК-1.3.1
23	Технологическое и специальное оборудование для производства испытаний.	ПК-1.3.1

24	Датчики давления прямого преобразования.	ПК-1.3.1
25	Датчики давления компенсационного типа.	ПК-1.3.1
26	МЭМС - датчики магнитного поля.	ПК-1.3.1
27	Преобразование базисов магнитных измерений.	ПК-1.3.1
28	МЭМС – компасы.	ПК-1.3.1
29	Цифровое микрозеркальное устройство (DMD). DLP – проекторы.	ПК-1.3.1
30	Микротранспортеры. Микротурбины.	ПК-1.3.1

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
	Учебным планом не предусмотрено

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
1	Элементы микромеханических гироскопов, отвечающие за возбуждение первичных и съём вторичных колебаний в микромеханических гироскопах: Датчики силы плоской структуры; Датчики моментов гребенчатой структуры; Датчики сил и моментов плоской или гребенчатой структуры. нет правильного ответа	ПК-1.3.1 ПК-1.У.1;
2	Основные схемы системы возбуждения колебаний чувствительного элемента микромеханических гироскопов: Опорный генератор Автогенераторная схема или опорный генератор Автогенераторная схема нет правильного ответа	ПК-1.3.1 ПК-1.У.1;
3	Закон вынужденных первичных колебаний ЧЭ камертонного ММГ $x = Ax \sin pt$, где амплитуда и частота Ax , $p=2\pi \cdot 10^4 \text{ с}^{-1}$; массы ЧЭ $m_1 = m_2 = m$; геометрический параметр рамки $b = 1500 \text{ мкм}$; технологические разбалансировки ЧЭ $y_{2T} = 0,1 \text{ мкм}$, $y_{1T} = 0$. Определить, пользуясь формулой для дрейфа (пятое слагаемое), максимальную величину угловой скорости дрейфа ММГ, обусловленного заданными разбалансировками. О т в е т: $\Omega_{dr} = py_{2T} / (4b) \approx 1 \text{ с}^{-1}$	ПК-1.3.1 ПК-1.У.1; ПК-1.В.1
4	Закон вынужденных первичных колебаний ЧЭ карданового ММГ $\alpha = E \sin pt$, где амплитуда и частота $E = 0,0159 \text{ рад}$, $p=2\pi \cdot 10^3 \text{ с}^{-1}$;	ПК-1.3.1 ПК-1.У.1;

	<p>закон вторичных колебаний ЧЭ $\beta = A\beta\sin(pt+\delta)$, где амплитуда $A\beta = 0,0001$ рад.</p> <p>Номинальные значения моментов инерции ЧЭ $A_{10} = B_{10} = 0,005 \cdot 10^{-12}$ Н·м·с²;</p> <p>вследствие технологических неточностей изготовления момент инерции B_1 на 1% отличается от номинального значения, т.е. $B_1/B_{10} = 0,01$.</p> <p>Определить, пользуясь формулой для дрейфа (первое слагаемое), максимальную величину угловой скорости дрейфа карданового ММГ, обусловленного заданным технологическим отклонением момента инерции B_1.</p> <p style="text-align: center;"> $\Omega_{dr} \approx \frac{B_{1T}}{A_{10}Ep} \ddot{\beta} = \frac{0,01B_{10}}{A_{10}Ep} A_{\beta} p^2 = \frac{0,01}{E} A_{\beta} p^2 \approx 0,395 \text{ с-1}$ </p> <p style="text-align: center;">О т в е т:</p>	ПК-1.В.1
5	<p>Дать определение МЭМС (MEMS) – это?</p> <p>МЭМС - это интегрированные системы с размерами от нескольких микрометров до миллиметров, которые объединяют в себе механические и электрические электронные компоненты. МЭМС состоит из механических микроструктур, микродатчиков, микроактюаторов и микроэлектроники, объединяемых на одном кремниевом чипе. Изготовление микроструктур возможно также из других материалов.</p>	ПК-1.У.1
6	<p>Выберите верные утверждения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Микромеханические акселерометры начинают находить применение в сейсмических системах записи. 2. У ММГ может быть использован только цифровой выход. 3. Микромеханические изделия в отличие от микроэлектроники содержат движущие или деформирующие элементы. 4. В ММГ инерционная масса приводится в движение за счет её вращения. 5. Главным источником погрешности ММГ является чувствительность к линейным ускорениям. 6. Собственная частота колебаний ММГ составляет не больше 100 Гц. 	ПК-1.3.1 ПК-1.У.1
7	<p>Начало развития МЭМС можно считать 1954 год. Именно тогда был открыт эффект кремния и германия, который лёг в основу первых датчиков давления и ускорения. Назовите этот эффект.</p> <p>Ответ: Пьезоэффект</p>	ПК-1.3.1 ПК-1.У.1

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала.

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе их развития на ближайшие годы;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об особенностях применения отдельных тематик по дисциплине.

Структура предоставления лекционного материала:

- ознакомление студентов с физическими законами и принципами функционирования микромеханических гироскопов и акселерометров;
- изложение методов математического описания динамики движения микромеханических гироскопов и акселерометров различных типов и оценки их метрологических характеристик;
- ознакомление с методами возбуждения и стабилизации колебаний механических масс микромеханических гироскопов;
- изложение способов регистрации движения чувствительных масс в микромеханических гироскопах и акселерометрах и первичной обработки измерений;
- ознакомление с вопросами проектирования отдельных функциональных узлов микрогироскопов и акселерометров и – приборов в целом;
- изложение методов и способов формирования обратных связей в микромеханических гироскопах и акселерометрах компенсационного типа;
- ознакомление со средствами автоматизации исследования и проектирования МЭМС;
- ознакомление с вопросами технологии изготовления микромеханических приборов и устройств;
- изучение факторов, определяющих погрешности микромеханических гироскопов и акселерометров и способов их компенсации.

–
11.2. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных работ

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-аналитической частей и контрольных мероприятий.

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося:

- приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, изучаемых в рамках данной дисциплины;
- закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на лекциях;
- получение новой информации по изучаемой дисциплине;
- приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным оборудованием и приборами.

Задание и требования к проведению лабораторных работ

Студенты разбиваются на подгруппы, по 3-4 человека. Перед проведением лабораторной работы обучающимся следует внимательно ознакомиться с методическими указаниями по ее выполнению. В соответствии с заданием обучающиеся должны подготовить необходимые данные, получить от преподавателя допуск к выполнению лабораторной работы, выполнить указанную последовательность действий, получить требуемые результаты, оформить и защитить отчет по лабораторной работе.

Структура и форма отчета о лабораторной работе

Отчет о лабораторной работе должен включать в себя: титульный лист, формулировку задания, теоретические положения, используемые при выполнении лабораторной работы, описание процесса выполнения лабораторной работы, полученные результаты и выводы.

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе

По каждой лабораторной работе выполняется отдельный отчет. Титульный лист оформляется в соответствии с шаблоном (образцом) приведенным на сайте ГУАП (www.guap.ru) в разделе «Сектор нормативной документации». Текстовые и графические материалы оформляются в соответствии с действующими ГОСТами и требованиями, приведенными на сайте ГУАП (www.guap.ru) в разделе «Сектор нормативной документации».

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может включать в себя контрольную работу.

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального уровня.

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу обучающихся являются:

- учебно-методический материал по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по заочной форме обучения).

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Порядок прохождения текущего контроля успеваемости определяется Положениями ГУАП «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Система оценивания:

1 тип) Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора считается верным, если правильно указана цифра и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответа. Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.

2 тип) Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора считается верным, если правильно указаны цифры и приведены конкретные аргументы, используемые при выборе ответов. Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

3 тип) Задание закрытого типа на установление соответствия считается верным, если установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого столбца). Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов

4 тип) Задание закрытого типа на установление последовательности считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр. Полное совпадение с верным ответом оценивается 1 баллом, если допущены ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.

5 тип) Задание открытого типа с развернутым ответом считается верным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте. Правильный ответ за задание оценивается в 3 балла, если допущена одна ошибка \ неточность \ ответ правильный, но не полный - 1 балл, если допущено более 1 ошибки \ ответ неправильный \ ответ отсутствует – 0 баллов.

По итогам тестирования выставляется оценка: «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». При получении менее 3-х баллов («неудовлетворительно») обучающемуся предоставляется возможность подготовиться и повторно пройти тестирование в сроки, предусмотренные учебным планом.

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план, предусмотренный рабочей программой дисциплины, по всем видам учебных занятий

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя:

– экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО ГУАП. СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в ГУАП» https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой